



半導体ウェーハ搬送機器

Semiconductor Equipment

EFEM

300mm 真空搬送ロボット

300mm Vacuum Transport Robot

ダイレクトドライブ (DD) モータ駆動
アームに平行4節リンク機構 + スチールベルトを採用
Ethernet通信制御対応
中空タイプDDモータでシンプルな駆動ユニットを実現

Direct Drive (DD) Motor
Structure with 4-link parallel to arm + steel belt
Ethernet communication control available
Hollow DD motor with simple driving unit is realized



300mm

Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation in the United States.
Ethernet は、Xerox Corporation の登録商標です。

LED/パワー半導体向け 基板自動搬送装置

Automated Wafer Transportation System
for LED / Power Semiconductor



LED/パワー半導体基板の大型化ニーズに対応
**Applicable for increasing size of
LED/Power Semiconductor Wafer**

150/200mm



Load Port

SINFONIA

シンフォニア テクノロジー 株式会社
クリーン搬送機器営業部

本社 / 東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー
TEL 03-5473-1838 FAX 03-5473-1847

SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.
Clean Transport Equipment Sales Department

Shiba NBF Tower, 1-30, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8564, Japan
TEL +81-3-5473-1838 FAX +81-3-5473-1847

CODE

N14-682

Content of this catalog may change due to product improvement without notice.

URL <http://www.sinfo-t.jp/>

1911B0.5P



シンフォニア テクノロジー 株式会社

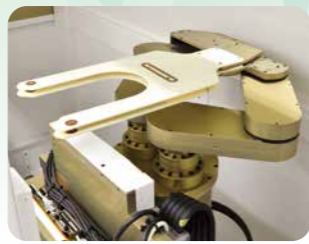
より高度で高効率な半導体テクノロジーをサポート

More Professionally, More Efficiently
Support Semiconductor Technology

EFEM LINEUP

300mm EFEM
SELEF/SO Series

300mm



300mm N2-EFEM

特長

非吸着/吸着ウェーハハンドリング (クリーンクラス1)

※ウェーハ裏面パーティクル付着を抑制

Vacuum-Less/Vacuum Wafer Handling (Clean Class 1)

Reduce adhering particles on back side of wafer

200mmウェーハ、石英ウェーハへの拡張対応可能 (300mmオプション)

Application to 200mm Wafer and Quartz Wafer

(300mm Option)

高速、高精度位置決め (±0.05mm)

High Speed and Accurate Wafer Handling (±0.05mm)

N2パージロードポート搭載可能 (オプション)

Installation of N2 Purge Load Ports (Option)

3ロードポート標準+増設可能 (オプション)

Standard 3 Load Port Type + Extendable Module (Option)

N2-EFEMも用意。極低レベル酸素濃度制御により酸素濃度100ppm未満をN2ガス消費量100LPMで達成

Special EFEM Product: N2-EFEM

Extremely low level oxygen density control achieves less than 100 ppm oxygen concentration with 100 LPM N2 gas consumption

耐食仕様への対応可能 (オプション)

Corrosion Resistance Compliance (Option)



300mm

300mm FOUF ソータ

300mm FOUF Sorter



3×3port、4×4portなど、豊富なバリエーションを用意

Providing plenty of variations such as 3x3 port, 4x4 port etc. to meet customers requirement

LOAD PORT

LINEUP



Contribution to Further Miniaturization Releasing Next Generation Load Port !

300mm FOUF ロードポート

300mm FOUF Load Port

Smart SELOP-8 Series

300mm

独自機構の採用でよりスムーズなFOUPドア開閉を実現

エア/電動のハイブリッド動作機構により、ドア開閉時の振動を抑制し、パーティクルパフォーマンスが大幅に向上。最新の高气密性FOUPにも対応。

Extremely Smooth FOUP Door Open/Close Motion

Great improvement of particle performance
Reduction of vibration during door open/close by hybrid of pneumatic and electric driven mechanism.
Compliance of high sealed FOUP.

N2 Purge Function
N2パージ対応

MCBF
1,000,000 cycles achieved
MCBF1,000,000サイクル達成

N2 Upgradable On-Site
現地改造可能



One Configuration Available in Both 300mm and 200mm!

200/300mm

200/300mm 自動切り替え機能搭載ロードポート

200/300mm Wafer Auto Switching Load Port

Smart SELOP-7

オープンカセットアダプタを載せるだけで200mmウェーハ対応LPに!

- 300/200mm両対応のマッパーを採用。
- ウェーハ飛出し防止機構を採用。
- ウェーハ搬送中はアダプタドアが開かない安全ロック機構。



300mm Wafer is also available to 200mm Wafer LP by just setting Open Cassette Adapter.

- 300/200mm Wafer mapping function. (No Change Required)
- Preventing mechanism for wafer protrusion.
- Safety lock function to keep adapter door close when wafer is being transported.

